

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Elektrónový mikroskop s príslušenstvom – 1komplet

- Skenovací elektrónový mikroskop s možnosťou práce vo vysokom a nízkom vákuu s katódou typu FE Schottkyho emitör, LaB6 alebo ekvivalent
- Detektory SE, BSD a EDS
- Energetické rozlíšenie EDS detektora: MnK α , min. 20 000 cps pri 130 eV
- Možnosť vkladania vzoriek do komory skenovacieho elektrónového mikroskopu s priemerom min. 200 mm
- Rozlíšenie vo vysokom vákuu: min. 3 nm pri 30 kV a min. 8 nm pri 3 kV
- Hraničná hodnota tlaku v nízkom vákuu 400 Pa alebo lepšia
- Urýchľovacie napätie v rozsahu min. 0,3 kV - 30 kV
- Prúd sondy v rozsahu min. 2 pA – 200 nA
- Priame zväčšenie v rozsahu min. 8 $\times$ - 300 000 $\times$
- Analytická pracovná vzdialenosť max. 10 mm
- Kompucentrický alebo eucentrický stolík s pohybom min. v 5 osiach x, y, z, T a R;
X = min. 80 mm, Y = min. 40 mm, Z = min. 35 mm, T = min. v rozsahu -30° až +50°, R = min. 360°.
- Color CCD náhľadová kamera
- Navigačná kamera
- **Príslušenstvo:**
 - Naprašovačka (Sputter coater)
 - Zariadenie na prípravu vzoriek CPD (critical point dryer)

Prístroj musí byť kompatibilný v korelatívnej mikroskopii s optickými mikroskopmi ZEISS, ktoré verejný obstarávateľ vlastní.

Vypracoval: Mgr. J. Littva, PhD.

Názov projektu: **Realizácia programov starostlivosti o NPP Demänovské jaskyne a NPP Zápoľná jaskyňa**

ITMS2014+ kód: **310011V993**

Operačný program: **Kvalita životného prostredia**